

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2015年10月8日(08.10.2015)



(10) 国際公開番号

WO 2015/152317 A1

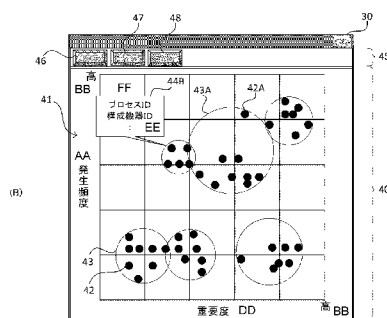
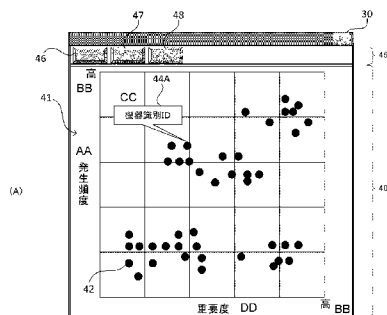
- (51) 国際特許分類:
G05B 23/02 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2015/060293
- (22) 国際出願日: 2015年3月31日(31.03.2015)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2014-075095 2014年4月1日(01.04.2014) JP
- (71) 出願人: 株式会社ティエルバイ (TLV CO., LTD.)
[JP/JP]; 〒6758511 兵庫県加古川市野口町長砂 8
8 1 Hyogo (JP).
- (72) 発明者: 伊原 健太 (IHARA, Kenta); 〒6758511 兵
庫県加古川市野口町長砂 8 8 1 Hyogo (JP). 宮前
嘉夫 (MIYAMAE, Yoshio); 〒6758511 兵庫県加古川
市野口町長砂 8 8 1 Hyogo (JP).
- (74) 代理人: 佐々木 康, 外 (SASAKI, Yasushi et al.); 〒
6310003 奈良県奈良市中登美ヶ丘 4 丁目 2 番地
1 7 - 5 0 4 Nara (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA,
BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN,
CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN,
IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR,
LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX,
MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH,
PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK,
SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW,
MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユー
ロピア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨー
ロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE,
ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC,
MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR),

[続葉有]

(54) Title: RISK EVALUATION SYSTEM FOR PROCESS SYSTEM, RISK EVALUATION PROGRAM, AND RISK EVALUATION METHOD

(54) 発明の名称: プロセスシステムのリスク評価システム、リスク評価プログラム及びリスク評価方法

[図2]



AA Occurrence frequency
BB High
CC Device identification ID
DD Importance
EE Constituent device ID
FF Process ID

(57) Abstract: This risk evaluation system for a process system is equipped with: a storage unit, an operation unit, a calculation unit, a risk evaluation unit, and a display unit. The calculation unit calculates first and second factors to be used for risk evaluation related to specific constituent devices of respective processes on the basis of predetermined information about the specific constituent devices. The risk evaluation unit generates device risk evaluation information to be used for displaying a device risk evaluation matrix, including plot images that are defined by two axes comprising the first and second factors and plotted on the basis of the calculated first and second factors of the specific constituent devices. In addition, the risk evaluation unit generates the device risk evaluation information in such a manner as to achieve a display mode in which the plot images of the respective specific devices constituting the same process can be identified from one another.

(57) 要約: プロセスシステムのリスク評価システムは、記憶部、操作部、算出部、リスク評価部及び表示部を備える。算出部は、プロセスを構成する特定の構成機器に関するリスク評価に用いる第一要因及び第二要因を、特定の構成機器に関する所定情報に基づいて算出する。リスク評価部は、第一要因及び第二要因の2軸で定義され、算出された特定の構成機器の第一要因及び第二要因に基づいてプロットしたプロット画像を含む機器リスク評価マトリクスを表示するための機器リスク評価情報を生成する。また、リスク評価部は、同一プロセスを構成する特定の構成機器のプロット画像を特定可能な表示態様で機器リスク評価情報を生成する。

WO 2015/152317 A1

WO 2015/152317 A1



OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))